PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

62-100936

(43)Dat of publication of application: 11.05.1987

(51)Int.CI.

H01J 37/20 GO1N 23/225 H01J 37/10

(21)Application number: 60-242471

(71)Applicant:

SHIMADZU CORP

(22)Date of filing:

28.10.1985

(72)Inventor:

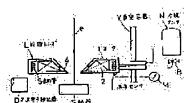
KOYANAGI KAZUO

MURAYAMA YOSHIMI

(54) SAMPLE CONTAMINATION PREVENTIVE METHOD FOR ANALYZER UTILIZING CHARGED PARTICLE BEAM (57)Abstract:

PURPOSE: To make an object itself a cold trap and improve the contamination preventive effect of a sample, by furnishing a coolant flowing means to a yoke of the object lens to cool forcibly, in an analyzer utilizing charged particle

CONSTITUTION: An object lens L of an analyzer utilizing particle beams such as an electron beam microanalyzer is made by furnishing a copper pipe 5 along the inside of its yoke 1, and the both ends of the copper pipe 5 are picked out from the side wall of the yoke to connect to a coolant tank N. By delivering a liquid nitrogen or the like to the copper pipe 5, the temperature of the object I ns L is dropped to a low temperature and a contamination of a sample S by absorbing the residual gas is prevented. Therefore, the surface area of the object lens itself can be increased to be a cold trap to improve the cooling effect, as well as no member can be placed between the sample S and the lens L in order to give no disturbance to detect the secondary electrons and the lik .



LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted r gistration]

[Dat of final disposal for application]

[Patent number]

[Dat of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

Copyright (C); 1998,2000 Japan Patent Office

⑩ 日本国特許庁(JP)

昭62 - 100936 ⑫公開特許公報(A)

@Int_Cl.4

識別記号

庁内整理番号

△公開 昭和62年(1987)5月11日

37/20 H 01 J G 01 N H 01 J 23/225 H OI 37/10

7129—5C ·2G

発明の数 1 (全3頁) 審査請求 未請求

69発明の名称

荷電粒子線を用いた分析装置の試料汚染防止方法

昭60-242471 顖 創特

昭60(1985)10月28日 顖 ❷出

小 仍発 明 者

和 夫 京都市中京区西ノ京桑原町1番地 株式会社島津製作所三

条工場内

村 明 者 勿発

個代 理

美 簭 Ш

柳

京都市中京区西ノ京桑原町1番地 株式会社島津製作所三

冬丁場内

仍出 願 人

株式会社島津製作所

弁理士 県 浩 介 京都市中京区河原町通二条下ルーノ船入町378番地

旫

1. 発明の名称

荷電粒子線を用いた分析装置の試料荷染物止方法

2. 特許請求の範囲

荷電粒子線の対物レンズのヨークに冷媒流通手段 を設け、対物レンズを強制的に冷却することを特 改とする荷電粒子線を用いた分析装置の試料汚染 防止方法。

発明の詳細な説明

イ、産業上の利用分野

本発明は電子線マイクロアナライザとか走査型 電子顕微鏡等の位子線を用いる分析装置における 試料汚染防止方法に聞する。

ロ、従来の技術

電子線マイクロアナライザ等で試料に電子線を 当てて分析を行う場合、真空容器内の残留ガスの 吸着によって試料表面が汚染されることがある。 特に試料を低温にして分析する場合、この吸着汚 些が顕著になり、分析上の疑惑になる。このよう な汚染を低減する方法として従来から試料の近傍 に試料より低温の物体を配置して汚染物質を試料 よりも先にその低温物体に吸着させてしまう、い わゆるコールドトラップを配置する方法が用いら れている。第2因はそのコールドトラップの一例 で、電子光学系の対物レンズLの下に環状のコー ルドトラップCを対物レンズLと同軸的に配置 し、コールドトラップを支持する腕棒を真空容器 Vの外に引き出し、液体密素タンクNに結合し て、この腕棒を冷却し、熱伝導によってコールド トラップCを冷却すると云う構成である。

上述したような構成で、試料から放射される分 析情報線のうちX線はコールドトラップC、対物 レンズLの中心孔を通って対物レンズの上からX 線分光器に入射せしめられる。また他の分析情報 線である2次電子は試料Sの側方に配置された2 次電子検出器 Dに吸引される。この2次電子の検 出に当たってコールドトラップCは2次電子の検 出器 D に向かう経路内に位置することになるた め、なるべく2次電子の検出を妨害しないよう、 小さな環形に作られることになる。

ハ、発明が解決しようとする問題点

上述したコールドトラップを用いる従来の汚染防止法は2次電子の検出を妨害しないと云う要請から形状が制限され、表面積が小さく、外部からの熱伝導による冷却であるから充分に冷却することが困難で、表面積不足、低温不充分であるため、充分な汚染防止効果は得られなかった。

本発明は簡単な構成で強力な汚染防止効果の得られる方法を提供しようとするものである。

二、 間題点解決のための手段

電子光学系の対物レンズに冷媒流通手段を設けて、対物レンズのヨークを冷却し対物レンズ自身 をコールドトラップとした。

ホ.作用

۰۰۰ صنع

対物レンズは試料に近接して対向しており、は 料対向面は広い面積を持っている。汚染防止能力 はトラップの吸着能力によって決まり、吸着能力 は面積が大きい程また低温である程大きい。本発 明の構成では対物レンズ自体がコールドトラップ となるので面積は従来のコールドトラップに比し

が所望の温度を指すように手動的に翻節井を調節する。もちろんこの調節は自動化してもよい。また冷媒は上例では液体窒素を直接用いているが、本発明では冷媒効果が良いので、鋼管 5 には液体窒素そのものでなく、液体窒素その他で冷却された他の冷媒を循環させるようにしても良い。

卜. 効 果

4. 図面の簡単な説明

充分大であり、また対物レンズに冷媒液通手段を 設けて直接冷却するので容易に充分な低温が得ら れ、しかも試料と対物レンズとの間に別の部材を 配置するのではないから、2次電子検出に対して 全く妨害作用がない。

へ. 実施例

> 第1 図は本発明の一実施例の要節縦断側面図、 第2 図は従来例の経断側面図である。

> > 代理人 弁理士 縣 浩 介

特開昭62-100936 (3)

